

Qufab装置利用単価表

2024年4月1日

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術補助費	技術代行費
				(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
Qufab001	i線ステッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィ装置	47,200	54,200	55,800
Qufab002	インライン型コータディベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィ装置	47,200	54,200	55,800
Qufab003	セミオートディベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィ装置	32,200	39,200	40,800
Qufab004	ウエハー洗浄装置	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	41,200	48,200	49,800
Qufab005	有機洗浄装置A	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	35,200	42,200	43,800
Qufab006	有機洗浄装置B	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	35,200	42,200	43,800
Qufab007	Nb-AIジョセフソン接合作製装置 [In-situ 分析器 & オゾン酸化器付]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab008	Nb-AIジョセフソン接合作製装置 [標準型]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab009	NbNジョセフソン素子作製装置	CR2 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab010	マルチターゲット（六源）スパッタ装置	CR4 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab011	絶縁膜作製装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab012	TEOS-CVD	CR3 クリーンルーム	成膜装置	47,200	54,200	55,800
Qufab013	反応性イオンエッチング装置Samco-II	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab014	反応性イオンエッチング装置Samco-III	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	32,200	39,200	40,800
Qufab015	反応性イオンエッチング装置 (Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab016	ICP型反応性イオンエッチング装置 (Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab017	イオンミリング装置	CR3 クリーンルーム	エッチング装置	35,200	42,200	43,800
Qufab018	酸系ウェットエッチング装置	CR1 イエロールーム	エッチング装置	32,200	39,200	40,800
Qufab019	マニュアルプローバ	CR3 クリーンルーム	測定装置	26,200	33,200	34,800
Qufab020	シート抵抗測定装置	CR3 クリーンルーム	測定装置	26,200	33,200	34,800
Qufab021	ナノサーチ顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置	38,200	45,200	46,800
Qufab022	レーザ顕微鏡	CR1 イエロールーム	測定装置	38,200	45,200	46,800
Qufab023	段差計	CR3 クリーンルーム	測定装置	26,200	33,200	34,800
Qufab024	CMP1	CR3 クリーンルーム	表面処理装置	41,200	48,200	49,800
Qufab025	CMP2	CR7 クリーンルーム	表面処理装置	32,200	39,200	40,800
Qufab026	有機ドラフトチャンバー	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	3,000	10,000	11,600
Qufab027	無機ドラフトチャンバー	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	3,000	10,000	11,600
Qufab029	ICP型反応性イオンエッチング装置（フッ素系）	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab030	ICP型反応性イオンエッチング装置（塩素系）	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	41,200	48,200	49,800
Qufab031	光学膜厚計	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,000	10,000	11,600
Qufab032	顕微分光光学膜厚計	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,000	10,000	11,600
Qufab033	クラスタースパッタ装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab034	アッシング装置	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab035	ALD装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab036	斜め蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab037	走査電子顕微鏡	CR5 クリーンルーム	測定装置	38,200	45,200	46,800
Qufab038	デバイス評価装置	1136室実験室	測定装置	38,200	45,200	46,800
Qufab039	シリコン深堀エッチング装置A	CR7 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab040	シリコン深堀エッチング装置B	CR7 クリーンルーム	エッチング装置	38,200	45,200	46,800
Qufab041	パンプ形成用成膜装置	CR9 クリーンルーム	成膜装置	44,200	51,200	52,800
Qufab042	フリップチップボンダー	CR8 クリーンルーム	表面処理装置	38,200	45,200	46,800

※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。  
 ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数がかかります。  
 詳しくはQufab事務局にお問い合わせください。

中小企業(中小企業支援法第2条) 0.5  
 大学, 公的研究機関 0.5  
 上記に該当しない場合は 1